

第三期 大型仪器系列培训活动 ——ZYGO干涉仪 (GPI XP/D)



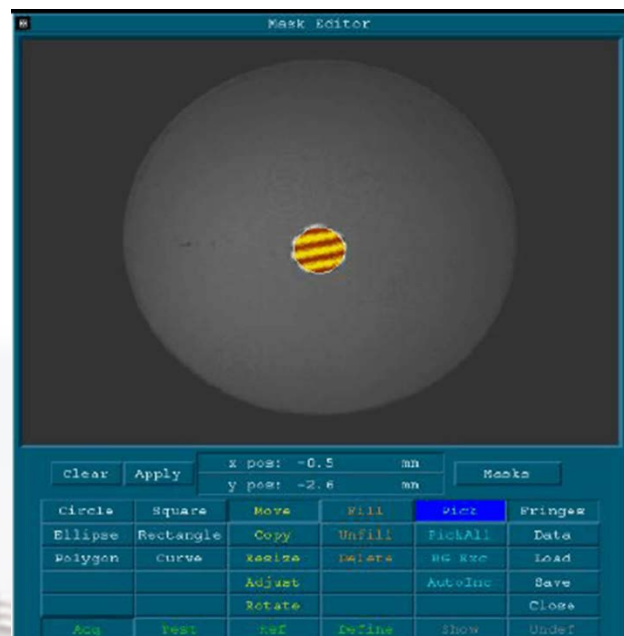
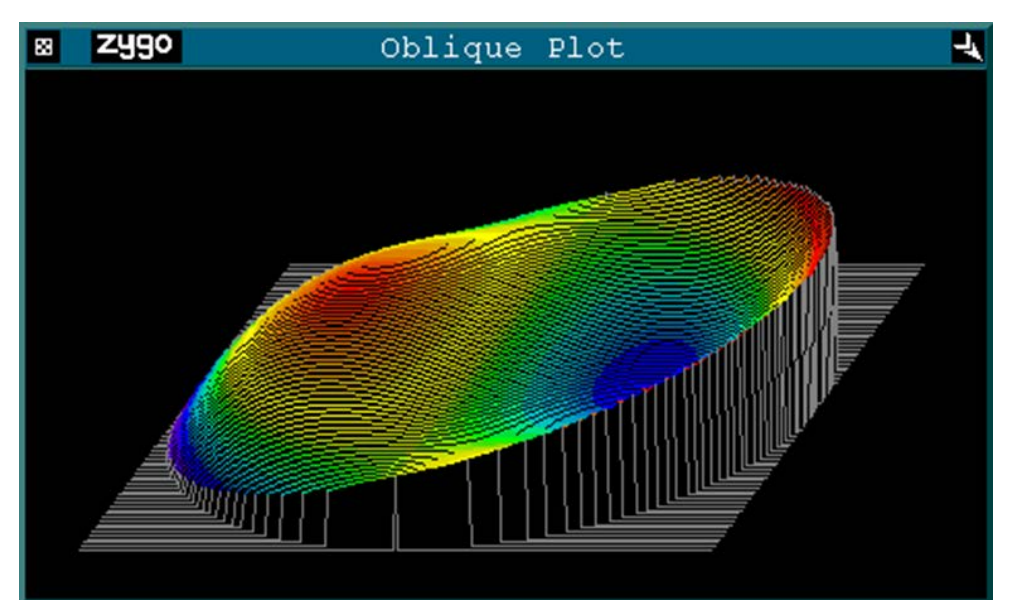
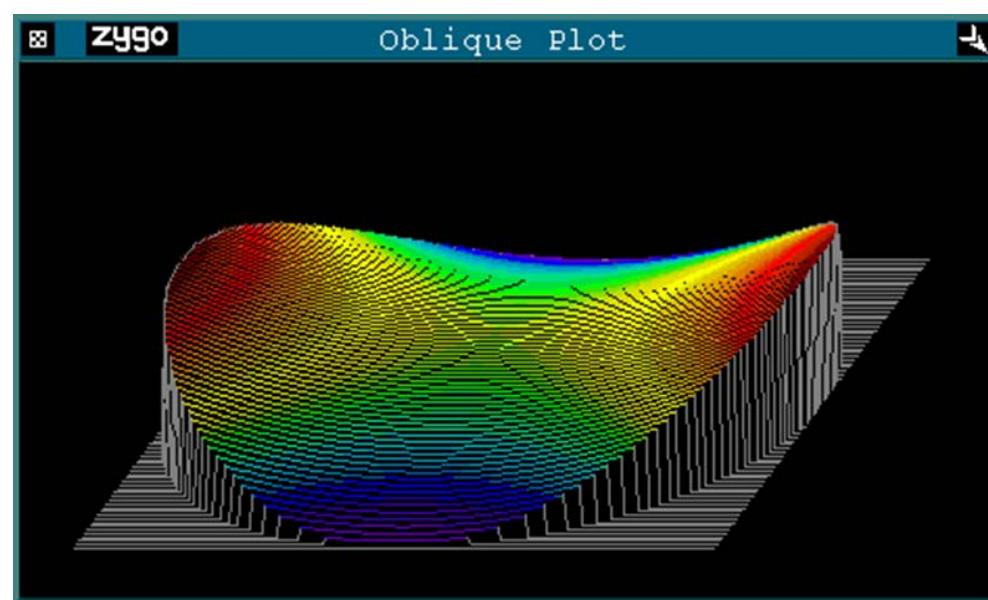
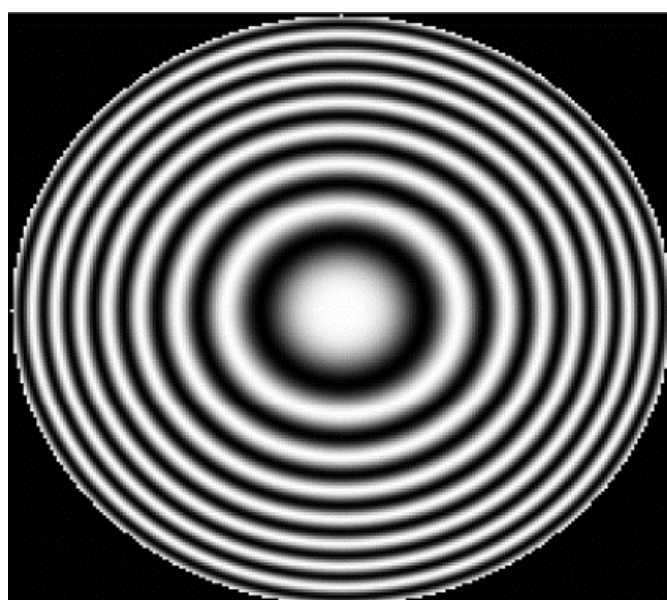
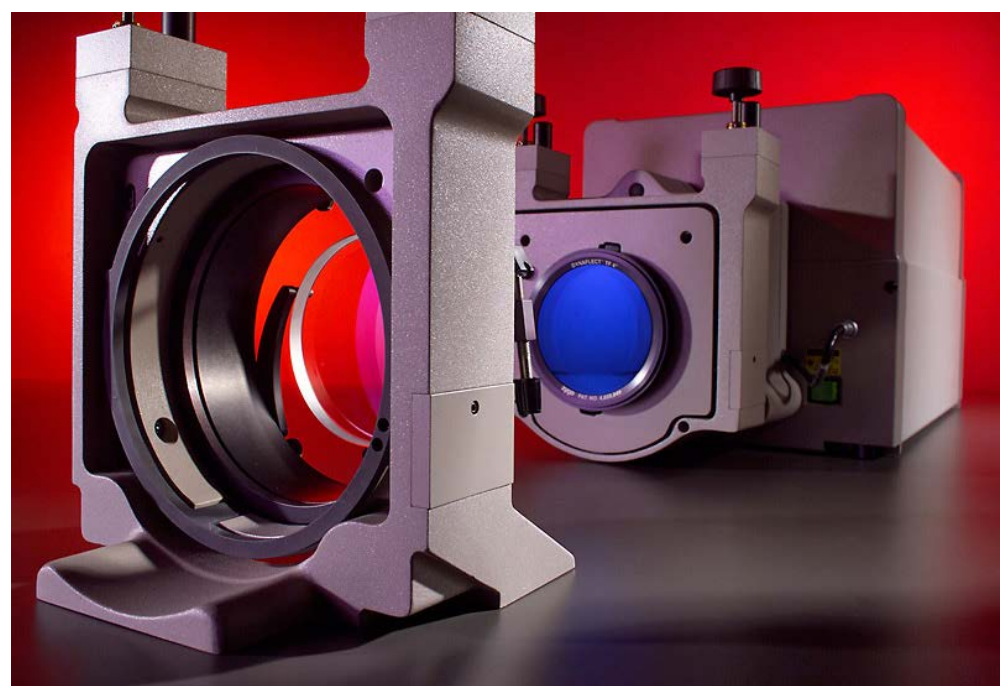
光电学院大型仪器服务平台

<http://www.moi-lab.zju.edu.cn>

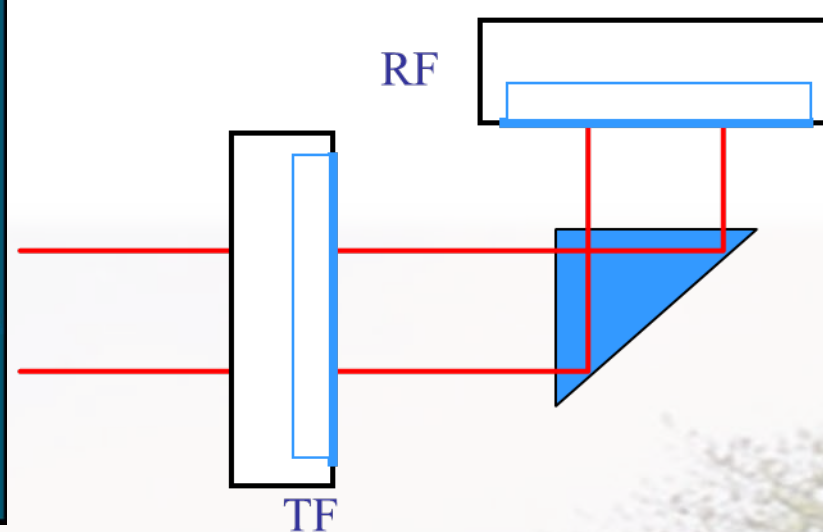
ZYGO干涉仪运用移相干涉原理，提供高精度的平面面形，球面面形，曲率半径，样品表面质量，传输波前的测量和分析。广泛应用于科研教学和生产检测中，主机为Fizeau型干涉仪，测量精度高且操作简单，采用精密移相技术和高分辨率CCD接收器件，配合功能强大MetroPro软件可以获得高重复性和高精度的测量。

常用于：

- 平面和球面、柱面的面形检测
- 透过波前测量
- 光学材料均匀性测量
- 精密盘片质量检验
- 静态干涉条纹判断
- 平面楔角测量
- 球面曲率半径测量



Right angle prism



ZYGO干涉仪具有非接触、高精度、一次性量测等优点

主讲人：徐老师

培训类别：理论培训（免费）

培训时间：2019年6月21日10:30-11:30

联系电话：13588010452

Email: sunandwind@zju.edu.cn

培训地点：杭州市浙江大学浙大路玉泉校区教三440室

主办单位：

现代光学仪器国家重点实验室
浙江大学光电科学与工程学院
浙江省光学学会

